## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-287061

(43)Date of publication of application: 17.12.1991

(51)Int.Cl.

GO1N 27/406 GO1N 27/416

(21)Application number : 02-088164

(71)Applicant: TOKUYAMA SODA CO LTD

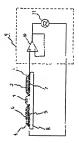
(22)Date of filing: 04.04.1990 (72)Inventor: NAKAHARA TAKESHI

# (54) GASEOUS HYDROGEN SENSOR ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To stably detect gaseous hydrogen without dispersion in measurement by constituting the above sensor element in such a manner that the electrode connected to a proton conductor contg. an electrolyte at a lower ratio has the lower sensitivity to hydrogen than the sensitivity to hydrogen of the electrode connected to a proton conductor contg. the electrolyte at a higher ratio.

CONSTITUTION: The content of the electrolyte in the proton conductor 1 is so adjusted as to be higher than the content of the electrolyte in the proton conductor 4. The protons 1, 4 are connected by the conductors 3, 6, 7 and the electrode 5 having the lower sensitivity to the hydrogen than the sensitivity to the hydrogen of the electrode 2 connected to the proton 1 is connected to the proton 4. A detector 9 directly measures a potential difference and consists of a voltage follower 10 and a pen recorder 11. The relation between the measured value by the detector 9 and the conc., of the gaseous



hydrogen is previously measured and the concn. of the gaseous hydrogen is determined from the measured value in the case of determination of the concn. of the gaseous hydrogen. This gaseous hydrogen sensor element substantially eliminates the fluctuations in the detected values by a change in temp. and humidity.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

### (9) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ②公開特許公報(A) 平3-287061

®Int CL 3

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)12月17日

G 01 N 27/406 27/416

6923 - 2.1

Z G H

6923 - 2 J

371 3 1 1 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称

水素ガスセンサ素子 ②特 顧 平2-88164

頤 平2(1990)4月4日

@発明者 山口県徳山市御影町1番1号 徳山曹達株式会社内 の出 顧 人 徳山曹逵株式会社 山口県徳山市御影町1番1号

1.発明の名称

水素ガスセンサ素子

2. 特許請求の範囲

(1) 電気的に接続された、電解質の含量が異な るプロトン運電体に、水素ガスに対して活性を有 する電極を各々接続して構成された素子であって、 雪解質の含要が少ないプロトン選貫体に接続する 音馬が、智能質の会響が多いプロトン運管体に接 続する電極に対して水素に対する感度が低いこと を特徴とする水素ガスセンサ素子。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規な水業ガスセンサ業子に関する。

(従来の技術及び問題点)

従来、気体中の水業ガスを検出する方法として 酸化物半導体式ガスセンサや電気化学式ガスセン サを利用した方式が採用されてきた。しかしなが ら、酸化物半導体式ガスセンサをはじめとする固 体型ガスセンサは、ヒーターによる加熱が必要な

ため、消費電力が大きく携帯用途に使用しにくい 欠点があった。またヒーターを使用するため防爆 構造が要求され、大型で高価なものになるといっ た問題点もあった。一方、室温作動型の雲気化学 式ガスセンサは、消費電力が小さい反面、電解液 を用いた液体型であるため、寿命が短く小型化し にくいといった問題点を有していた。かかる既存 センサの欠点を解決するためにプロトン薬電性固 体電解質を利用した。固体型で常進作動型のガス センサ素子が提案されている。

例えば、プロトン連載性固体質疑者をポリビニ ルアルコール等の結合剤によって成形したプロト ン享電体に検知電極として白金電極を、参照電極 として水素に対する活性のない銀電極を接続した 水素ガスセンサ素子が提案されている。上記水素 ガスセンサ素子は、被検ガスが検知電極と接触し たときに生じる起電力を検出器で測定して抜被検 ガスを検知するものである。

しかしながら、上記のプロトン道雷性間及雷艦 質組成物を結合剤を用いて成形したプロトン選電

体を使用した水素がスセンサは、使用温度が常温 であるために、周囲の温度、湿度の変動による影響を受けやすく、速度(検出値)にバラツキが生 じ器いという欠点もあった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者等は、上記の問題点を解決するために 級意研究を重ねた結果、電気的に接続された、プ ロトン連電性電解質の書置が異なる2種類のプ トン連電体に特定の電価を各・機械することによ 別、温度・速度の変化に対して、検出値の変化が 低的て少ない水素がス検知素子が得られることを 見い出し、本拠明を完成するに至った。

即ち、本発明は、電気的に接続された、電解質の含量が異なるプロトン源電体に、水来ガスに対して活性を有する電話を各々接続して構成された。 来子であって、電解質の含量が少ないプロトン深電体に接続する電話(以下、参照電話という)が、電解質の含量が多いプロトン深電性に接続する電信(以下、検知電話という)が対して、検知電話という)に対して来まに対する感度が低いものを使用することを特徴とするメ 差ガスセンサ素子である。

本発明で用いるプロトン運電体は、プロトン選 電性を有するものであれば公知のものが何ら制限 なく使用できる。例えば、プロトン調管性間体質 無質を結合剤により底形したものが一般的である が、上記プロトン運電性固体電解質と共に会成成 オン基電性固体電解質を使用したものが、類成素 体のインピーグンスを低下させ、得られる水素セ ンサ素子における場所)イズの影響を低減させ、 ローカ素がスに対ける感度を選択的に向上させる ことができ様に好ましい。

者が20重量部未満では、得られるプロトン導電

ル(HUO\*PO\*・nH\*O) 、 H型ゼオライトで代表され る各種の無機イオン交換体、ポリスチレンスルホ ン酸、Nafion (デュボン社の登録商標) で代表さ れる有機高分子イオン交換体等を挙げることがで きる。上記プロトン導電性固体電解質は、単独で、 あるいは2種以上を混合して用いることができる。 また、結合剤としては、プロトン導電性固体電 解質の特性を阻害せず、且つ該プロトン導電性固 体電解質と混合することによって、これに成形性 を付与し得るものであれば公知のものが何等制限 なく使用できる。一般には、抜プロトン薬電性圏 体電解質粉末の空隙を効率よく充塡できる有機結 合割が好適に採用される。具体的には、エポキシ 樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フェノール 樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ業系樹脂等が挙げら れる。また、結合剤の使用量は、プロトン導電性 固体電解質の形状、粒径等によって異なるが、一 般には、該プロトン導電性固体電解質100重量 部に対して20~100重量部、好ましくは25 ~50重量部の範囲で使用される。結合剤の使用

体の強度が低下し、また、100重量部を越える 場合にはプロトン導電性が低下する傾向がある。 更に、金属イオン導電性固体電解質は、プロト ン導電性を示さず金属イオン導電性を示す固体電 解質であれば何等制限なく用いることができる。 かかる金属イオン導電性固体電解質を具体的に例 示すれば、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレ ソナキシド等のポリエーテル類、及び、Li, Na, K等のアルカリ金属の過塩素酸塩、チオシアン酸 塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩等の塩より なる高分子錯体固体電解質、βーアルミナ、βー ガリア、ナシコン、リシコン等の酸化物固体電解 質、ヨウ化銀、塩化銅、ヨウ化銅等のハロゲン化 合物固体電解質などが挙げられる。これらの内、 **쑢に、高分子錯体固体電解質は、有機結合剂に**溶 解し、結合剤中に高分散して効率的に作用するた

上記の金属イオン導電性固体電解質の割合は、 結合割100重量部に対して10~200重量部、

め好液である.

好ましくは30~150重量部の配関である。本 発明において、金属イオン幕理性を解析した。 がしたようにプロトン席理性を無例のイマにト グンスを伝摘させると共に、関ラとして用いたせる。 本無におする感度、選邦とを審しく向上させる。 本素にお性をも改善する数別表によっての解析 果、及び上記したガスセンサとしての特性が会 に、インビーダンスの低減効果は零しいが、 のよりによっていましたがある。 をには、インビーダンスの低減効果は零しいが、 のよりによっていましたがある。 かけましくない。

本発明において、プロトン運電体の製造方法は 特に限定されず、プロトン深電性固体電解質、結 合剤及び必要により金属イオン運電性固体電解質 の性状に合わせて適宜行えばよい。例えば、プロ トン運電性固体電解質が共に初かり場合には、ボール 運動と関係では、ボール ミル等で十分に合し。 体 組成制を調整することができる。かかる<del>組成物</del>の 成形は、プレス成型が一般に採用される。また、 結合剤が液状の場合には、予め金属イオン導電性 固体電解質を結合剤に溶解あるいは分散させた後、 プロトン導電性固体電解質と混合しペースト状と する方法が好通である。かかる 最大的の成形方法 としては、御馴したペーストを型に往入あるいは 印刷等の方法で基板上に形成し、有機結合剤を固 化させる方法が一般的である。なお、有機結合剤 が、ピニル基やエポキシ基等の重合可能な基を有 する単量体の場合は、これを重合硬化させること により、有機結合剤を溶媒に溶解せしめて液状と した場合は、これを一定の形状にキャスティング した後、該溶媒を揮発させる方法が一般に採用さ れる。上記成形方法のうち、単置体よりなる有機 結合剤を使用し、これを重合硬化させる方法は、 溶鍵を用いないため、溶媒揮発時のポイドの発生 がなく、好適である。

上記プロトン課電体の形状は、公知の形状が特に制限なく採用される。例えば、板状(層状)、

チップ状、棒状等が一般的であり、センサの設計 に応じて通宜選択すればよい。

本発明において、上記プロトン導電体は、含有される電解質含量が異なるものを電気的に接続して使用される。

上記した各プロトン選電体の電解質含量の差は そのプロトン選電性に基が生じる範囲であれば特 に削壊されないが、本発明の効果を大限に発性 であためには、一方のプロトン基電体の見解では対して、 他方のプロトン基電体の電解質含量が5重量が5 解質含量を顕飾することが好ましい。即ち、上記 電解質含量を顕飾することが好ましい。即ち、上記 電解質含量を影が5重量分末端の場合は、得られ る水素ガスセンサ素子の水素に対する態度が低下 する瞬間がある。

かかる電解質含量の調整は主としてプロトン導 電性固体電解質の含量において行えばよく、金属 イオン電性固体電解質を併用する場合には、該 電解質の含有量は、約起した使用範囲内で適宜決 定することができる。 また、電解質含量の異なるプロトン運電体を電 気的に接続する方法は特に制限されない。例えば るプロトン運電体を直接接合してもよいが、プロトン運電体の世級に対して不存性の運電体を介して 接続することが好ましい。かかる運電体を介して 技、額、金、カーボン等の接続ガスに対して不能 位 な材質、白金、パラジウム、ロジウム等の接続 ガスに対して感性な材質を使用することができる。 なお、再電体として接接がスに対して恐性な材質 を使用する場合、故障電体が被対なと接触しな いように開催器で確置することが好ましい。

上記簿電体によりプロトン導電体を電気的に接 接する程度は特に制限されない。 例えば、該導電 体よりなるリード線を使用する証拠、該導電体の 電電性ペーストを使用する証拠、これら組合せた 解機等が一般的である。

本発明において、検知電極及び参照電極は、水 素ガスに対して活性を有し、且つプロトン導電体 に対して不活性の材質であれば特に制限されない が、特に、白金、白金一パラジウム合金、白金一 二酸化スズ複合体、白金一ペロプスカイト型金属 酸化物複合体等の白金を含有する材質が好通に使 用される。

また、上記電極は、参照電極が検知電極に対し て水素に対する態度が低いものを使用することが、 本発明の目的を達成するために重要である。

上記歴度の基は、得られる水素がス独知素子の 窓度を上げるために、大きい程好ましく、更には、 未発明の目的とする温度、温度の変化による検出 値(感度)のパラツキモより効果的に防止するためには、各電像の低温度、低速度(例えば、10 で)における歴度と高温度、高温度(例えば、50 で、95 MR、H、)における歴度との差がは世 等しく、且つ参照電極の高温度、高温度(例えば、50 でせっに近い特性を有する電極材質を夫々選択することが肝ましい。前紀した自金を含有する電極 の材質は、後紀する気孔率を更えることにより、 かかる特性を有する検加電路及び参照環体表失れ かかる特性を有する検加電路及び参照環体表失れ 質である.

削記電極材質を夫々検知電極及び参照電極とし て使用する場合において、各電極に水素ガスに対 する感度の差を生じさせる手段は特に制限されな いが、上記電極間の気孔率を変える方法が最も好 遺に採用される。例えば、参照實施の気孔裏は30 体積が以上、好ましくはより~80体験がに、ま た検知電極の気孔率は20体積%以下、好ましく は3~15体積%となるように形成することが好 ましい。上記気孔率の調整はスクリーン印刷法、 スパッタ法あるいは無電解メッキにより電極を成 形した後に、焼成温度を制御する方法が最も好達 に採用される。好適な蜂成温度を例示すれば、糸 照電極を得るための焼成温度として600~900 てが、また、検知電極を得るための排成温度とし て参照電極の焼成温度より200~700で高い 温度で且つ1000 セ以上の温度が好適に採用される。 かかる電極の気孔率が異なることで何故、水素ガ スに対する感度が大きく異なるかは明らかではな いが、本発明者らは、水素ガスの拡散の差が病度

の差となって現われているものと推摩している。 以下、本発明を認面により具体的に説明する。 第1回は、本発明の代妻的な監棒の水素がスモン サ素子を含む水素がスモンサ装置の一例を示す。 聴聞である。回において、1及び4はプロトン連 電体であり、プロトン運電体1における電解質の含量がプロトン運電体における電解質の含量よ り多くなるように調整される。

また上記プロトン導電体1及び4は、課電体3。 6及び7によって電気的に接続され、且つプロト ン導電体4には、プロトン導電体1に接続された 電低(検知電低)2に対して水素に対する感度が 低い電低(参照電低)2に対して水素に対する感度が 低い電低(参照電低)5が接続される。

また、上記水業ガスセンサ素子の出力を検出するための9は検出器、8は絶縁性基板である。

前記検出器<u>9</u>は、上記水業ガスセンサ素子において生じる電気的変化を検出し得るものであれば特に制限されない。例えば、電位差を直接測定するもの、該電位差に基ずく内部電位差を測定するもの、該電位素に基ずく推作率化を増せするもの。

あるいは上記参照電信と検知電信を短端したとき に流れる短端電波の変化を測定するもの等が一般 的である。なお、第1回の検出器<u>9</u> は電位変を直 環境定するものでポルテージフォロフ10 とペマ レコーダー11よりなる。また、米書がス機度の 定置を行う場合には、上記検出器による機定値と 米書がス機度との関係を予め機定し、これにより 規定値か米素がス機度を求めればよい。

上記検出募を接続した水素がスセンサ整理の能 様は、水素がスセンサ素子における転電力を測定 し得る軽様が制限なく採用される。即ち、上記し た第1回気に示したように検知電極2と歩照電極5 に検出第2を接続する配様の他、上記検知電極2 と参照電極5を短線し、電電体7に代えて上記検 出募を接続することも可能である。

(効果)

以上の説明より理解されるように、本発明の水 素がスセンサ素子は、温度及び温度の変化による 検出値のパラツキがほとんどなく、安定して水素 ガスの検出を行うことができる。 また、プロトン薬電体の組成として、金属イオン薬電性固体電影を併用した場合には、上配数 展をより向上させることができると共に、一酸化 従業やアルコール等のガスに対する態度を係く抑えながら、米素ガスに対して、高い態度を有し、且つその応答性も違いという効果も免損する。(実施例)

本発明をさらに具体的に裁明するために、以下 実施および比較例を挙げて説明するが本発明はこ れらの実施例に限定されるものではない。

- なお、実施例及び比較例において、検知電極の 気孔率、ガス感度および水素に対する選択性を以 下の方法により測定した。
- ① 検知電極の気孔率:検知電値の表層、中層、下層の3つの層の電子顕微鏡写真を摄影し、電極部と気孔部の面積を算出し各層における気孔部の割合を平均し気孔率と定義した。
- ② ガス感度:ガス導入後、電位が平衡に達し たときの値からガス導入前の電位の値を整し 引いた値、以下、ΔΕΜΓと記す。

上に白金ペーストをスクリーン印刷し、1250でで 技成することにより検知電極を形成した。次に 関核に白金ペーストをスクリーン印刷、800で で技成した。後いでを知る程 2上に頼起プロトン運電性組成物ペーストのうう を分割電極5を形成した。後いでありま を分割電極5上に電解質金豊の高いもの(以下ペースト»と記す)を ・分解電極5上に電解質金豊の高いもの(以下ペースト»と記す)をそれぞれ印刷し、窒素雰囲 気下、120で、1時間加速することを結合列を 低いた・少率電体第1を形成した。次に、 各プロトン運電体第1を分成で、6を真空 業者法によって形成し、これらの運電体をリード 採よりなる運電体7で短端してセンサ素子を作製 した。

作製したセンサ素子のガス感復の測定は、以下 の方法により行った。センサ素子を20で、65 5 R. H. に調節したボックスに設置し、ボルケージフェロア10を通した後にペンシローダー11 に接続した。次に、評価するガスの適度が1000epse となるように、それぞれ米素と一般化炭素をボッ ③ 水素に対する選択性:水素の△EMFを一 酸化炭素の△EMFで削った値、以下、S(R₂) と記す。

実施例1,2、比較例1,2

ペンタエリスリトールトリアクリレート60重 豊部およびトリエチレングリコーレーアクリレー ト40重量部からなる結合剤混合物に、ボ豊重部 よび通塩素酸リチウム13重量部からなる金強属イ オン導電性圏体電解質を影加、混合し、溶解させ た。次に、転合剤混合物の固配化用機能としてベン 冷解させて、粘合剤と金属イオン運電性圏体電 質の混合溶液を調製した。プロトン運電性医体電 解質としてアンチモン酸(50±0)・8150) を用い、 これに配金溶液を加製した。プロトン運電性医いによって電解質含量の異なるプロトン運電性組成物ペーストとを複類顕製した。プロトン運電性組成物ペーストを2種類顕製した。

第1回に示した様に、絶縁性を基板 8 としてアルミナ基板 (縦 8.8 mm, 横 6.4 mm, 厚さ 0.6 mm)

クス内に往入し、間の電位へ変化の単動をベンレコーダー11を用いて観察した。全く同様の測定を、一1の「および50で、95 MR、用いっち行なった。得られた結果を変しに示した。また、上記妻子において、プロトン電電体の組成から金属イオン率電性関係電解質を除いた場合の結果を第1妻に併せて示す(実施別2)。

また、比較のため、第1回において、ペースト を用いた参照電極5例の素子を単独で用いた場合 合(比較例1)、及び第1回において、ペースト b を用いた、検知電極2例の素子を水素がスセン サ素子として単独で用いた場合(比較例2)のガ ス態度6回様に適定し、第1表に併記した。 実施3~5、比較例3

プロトン課電性固体電解質を第2表に示したものに代えた以外は実施例1と同様にして水素がスセッキ書子を作製し、同様の測定を行った。結果 を第2表に示す。なお、第2表の比較例3ではアトン課電性固体電解質に代えて、プロトン課電性多なのでは、100円に対した場合を含まれて、200円に対した場合を含くまさない。2歳化ケイ素を回来を加した場合を含まれて、2歳化ケイ素を回来を加した場合である。 成物を用いて作製したセンサ素子の特性を示した。 実施例 6

実施例1で用いた金属イオン導電性固体電解質 に代えて、ポリエチレンオキシト (平均分子量 3 5 0 ) 6 7 重量部、トリフルオロメタンスルホ ン酸リチウム33重量部からなる金属イオン運電 性固体質解質を用いた組成物を用いた以外は、実 **準備1 → 同様にして水素ガスセンサ素子を作製し、** 同機の測定を行った。その結果、-10℃におけ る水素1000ppm および一酸化炭素1000ppm に対す る速度 (AEMF) は、それぞれ181mVおよび 1 2 mVであり、水素に対する選択性 (S(Hz)) は 15.1 であった。また、20℃、65%R. H. アの水素1000com 及び一酸化炭素1000ppm に対す る悪度 (ΔEMF) は、それぞれ174mVおよび 1 0 mVであり、水素に対する選択性 (S(Hz)) は 17.4 であった。さらに、50℃、95%R. H. での水素1000ppm および一酸化炭素1000ppm に対 する感度 (ΔEMF) は、それぞれ 1 5 3 mVおよ び10mVであり、水素に対する選択性 (S(Na))

は15.3であった。 実験例7~9

電極材質を第3要に示した物質に代えた以外は、 実施例1と同様にして水素ガスセンサ素子を作製 し、同様の測定を行った。結果を第3要に示した。

し、同様の測定を行った。結果を第3表に示した。 実施例10 実施例1で作製したセンサ素子を用いて水素に

対する環度検を測定した。センサ素子を-10 セ、20年、65 5 R R H および50 年、95 5 R R H にそれぞれ調節したボックスに設置し、 センサ素子からのリード線をボルテージフォロフ を選した後にベンレコーダーに接続した。次に、 水素の環度がそれぞれ、30、100、300。 1000、3000ppm になるように所定量の本業を模式 ボックス内に往入し、電位変化をベンレコーダー にて測定した。各環度の水素に対するセンサ素子 の匿度を新く要に示した。

第 1 表 電解質含量 (重量%) | 検知電極の気孔率 (体積%)(純成温度 (モ)) | 水 素 に 対 す るΔEMF (aV) 一酸化炭素に対する A EVF (aV) S (11.) 200 5 0 T 500 200 5 0 T ×-210 -100 ~- z + b 検知電腦A 検知電腦目 -10T -10° esen a 95%R.R. 6534R. H. 95%R. H. 65549 H. 9516R. R. 家林田 1) (1250) 6 9.0 828 57 (800) 173 165 148 11 8 . 1 5. 7 206 1 8.5 - 1 末井子 60( - ) 13 (1250) 5.5 5 2 19 16 7 41 2.9 3.3 4.4 - 2 H-MARIE 690 57 (800) 134 4 8 3 3 17 5 4. 1 2. 8 0.6 - 1 H 电换 . . . 11 (1250) 318 254 149 49 27 16 6.5 7.6 9. 3 - 2

# 2 # 水 章 だ 村 す ふAFMF (aV) 一般化療学に対するAFMF (aV) S (H.) プロトン薬電性副体電話官 2 A T 5.00 200 5 0 T 200 SAT -107 -100 -100 65440 H 95%R. N 65%R. B. 95 14 R. H. 65%R. H. 9556R.B. 英雄州 Zr (HPO.), · nH.O 1 4 5 181 176 1 2 1 6.5 2 0.1 2 5. 1 - 3 AMP HUO, PO. . nH,O 1 4 2 130 124 10 7 3 1 4.2 17.7 413 - 4 **主体的** ポリステレンスのよう種 125 119 1 5 6 1 2 1.2 11 6 0 9.2 9. 9 - 5 比較例 \*> 0 n 0 0 0 0 - 3

<sup>\*) 2</sup>酸化ケイ常を添加

. . .

	# 3 X													
	1		検知電極の気孔率 (体	水震に対するAENF (all)			一般化炭素に対する A EVF(aV)			S (H <sub>x</sub> )				
ì	電腦	材質		* * * * *	~10T	200	500	-100	20°C	50°		200	50°C	
			F M 4 G	<b>a</b> 20 4 6	~100	65%R.H.	5%R.H. 95%R.N.	-100	65%R.B.	95% R. H.	-10t	65%R.B.	95%R.H	
类技術	~ 4		67 (700)	18 (1100)	152	137	133	14	11		1 0.9	1 2.5	2 6. 6	
~ 7			07 (700)	10 (1100)	132	137 1133	1.33	1,,	1.		10.9	1 2.5	20.0	
実施例	<b>a a</b>	8 0 重量部	51 (800)	13 (1250)	161	154	119	2 6	1 9	8	6. 2	8.1	1 4.9	
-8	パラジウム	2 0 重量部	51 (800)	13 (1250)										
実施例	白金	9 0重量部		14 (11 00)										
- 9	2 酸化スズ	10重量器	48 (800)	16 (1100)	2 3 1	208	192	5 3	49	3 0	4.4	4.2	6.4	

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の代表的な結構の水素ガスセン サ素子を含む水素ガスセンサ装置の機略回である。 1、4・・プロトン再選体、2・・検知電経、3・ 6、7・・運電体、5・・参別電路 、8・・・ 地縁性落 板、<u>9</u>・・・ 検出路、10・・・ ボルテージフェロア、 11・・・ ペンレコーダー。

特許出職人 德山曾建株式会社

第 1 図

